

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年1月6日(2005.1.6)

【公開番号】特開2001-282126(P2001-282126A)

【公開日】平成13年10月12日(2001.10.12)

【出願番号】特願2000-97873(P2000-97873)

【国際特許分類第7版】

G 09 F 9/00

G 02 F 1/13

G 02 F 1/1333

【F I】

G 09 F 9/00 3 5 0 Z

G 09 F 9/00 3 4 2 Z

G 02 F 1/13 1 0 1

G 02 F 1/1333 5 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成16年2月12日(2004.2.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

貼り合せるべき下基板を保持するテーブルと、上基板を保持する加圧板とを備え、該テーブル及び該加圧板にそれぞれ基板を保持して対向させ、位置決めを行うと共に間隔を狭めて、いずれかの基板に設けた接着剤により真空中で両基板同士を貼り合せる基板組立装置において、

下基板を着脱自在に保持する前記テーブルが真空チャンバ内に配置され、該真空チャンバ外に配置した複数のアクチュエータの各々から前記テーブルの側面部にX Yの各方向に伸びたアームが設けられ、該各アームにより前記テーブルをX Y方向に移動力を作用させることができ、それぞれのアームの伸長方向に対して交差する方向にはスライド機構を備えていることを特徴とする基板組立装置。

【請求項2】

請求項1において、

前記スライド機構が、前記テーブルの側面部にはT字状レールが設けられ、前記アームの端部にはローラが前記テーブルと前記T字状レールとの間に位置するよう配置した構成であることを特徴とする基板組立装置。

【請求項3】

請求項1又は2において、

前記真空チャンバは上チャンバと下チャンバとで構成され、前記上チャンバに前記加圧板が、下チャンバに前記テーブルがそれぞれ内蔵され、前記加圧板には上基板を保持するための真空吸着手段と静電吸着手段とを備えていることを特徴とする基板組立装置。